

ナノ3D光干渉計測システム

VS1330

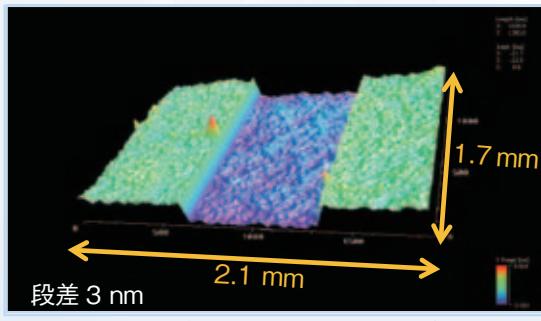
Nano 3D Optical Interferometer

ナノ3D光干渉計測システム(CSI)で解決しませんか?



- 高さ分解能を落とさず、広範囲を測定したい
- 測定データの信憑性(再現性)を上げたい
- うねり・粗さの測定を実現したい
- 高アスペクト比の形状測定を行いたい
- 安定した透明体膜厚測定を実現したい
- フラットな表面から凹凸の大きい表面まで1台で計測したい

対物レンズ倍率に依存しない高さ分解能



薄膜段差 表面形状 ワンショット画像

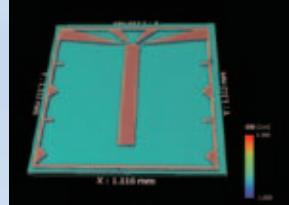
多層構造や層内部の欠陥評価が非破壊で可能



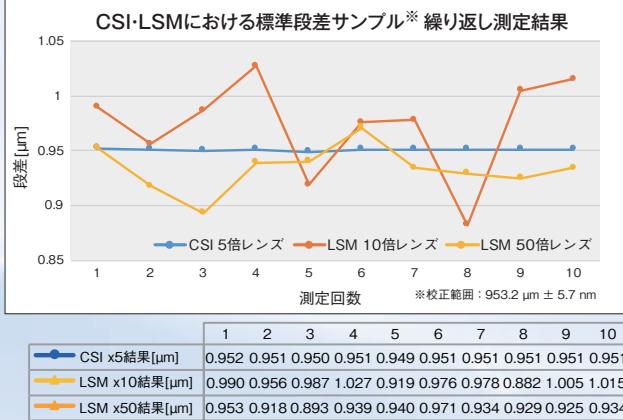
多層フィルム(偏光板)膜厚計測

信頼性ある測定再現性

3σ : 1.8 nmで計測

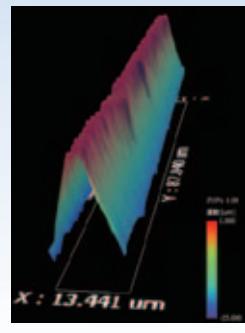
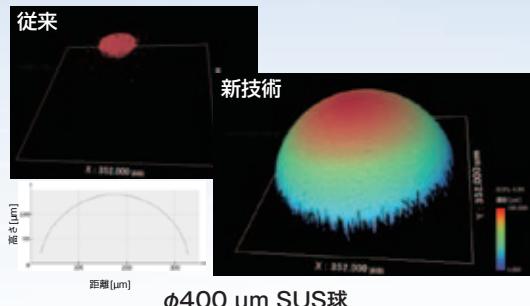


950 nm標準段差サンプル

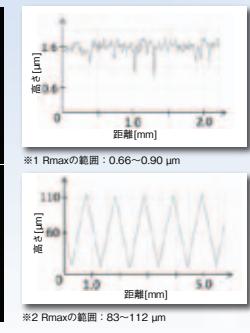


急峻な形状の測定を実現

高傾斜測定 87°まで計測



デザインナイフ刃先



粗さ標準片